

488696-2026 - Konkurrensutsättning

Irland – Laboratorieutrustning, optisk utrustning och precisionsutrustning (exkl. glas) – LA3215C-UCC-CFT for the Supply of a Suite of Plasma Etcher and Plasma Deposition Tools, 4 Lots

OJ S 134/2026 15/07/2026

Meddelande om upphandling eller koncession – standardsystem - Meddelande om ändring
Varor

1. Upphandlare

1.1. Upphandlare

Officiellt namn: Education Procurement Service (EPS)

E-postadress: info@educationprocurementservice.ie

Köparens rättsliga status: Offentligt styrt organ

Den upphandlande myndighetens verksamhet: Allmän offentlig förvaltning

2. Förfarande

2.1. Förfarande

Titel: LA3215C-UCC-CFT for the Supply of a Suite of Plasma Etcher and Plasma Deposition Tools, 4 Lots

Beskrivning: Tenders are sought for the supply delivery, installation and commissioning of a suite of tools in 4 Lots for silicon-based and dielectric materials for University College Cork. The new plasma tools will enhance the capabilities at the Tyndall National Institute for the fabrication of semiconductor devices, especially silicon microelectronics and silicon MEMS, but also other materials such as germanium and silicon carbide. We invite proposals for the following lots; Lot 1 Plasma Etcher Silicon Dielectrics, advanced plasma etching system capable of etching for polysilicon poly-Si silicon dioxide SiO₂ silicon nitride SiN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 2 Plasma Etcher Metals Piezoelectrics, advanced plasma etching system capable of etching for aluminium Al and alloys molybdenum Mo aluminium scandium nitride AlScN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 3 Plasma Etcher Slow and Controllable Rate Atomic Layer Etch for Silicon Dielectrics, advanced plasma etching system capable of both conventional high-rate etching and slow and controllable rate atomic layer etching for silicon Si silicon dioxide SiO₂ silicon nitride SiN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 4 Plasma Deposition PECVD, advanced plasma enhanced chemical vapour deposition system capable of depositing dielectric SiO₂, SiN and amorphous a-Si thin films on semiconductor substrates. This equipment will be essential for etching and depositing a range of materials used in the fabrication of silicon microelectronics, silicon photonics and silicon MEMS devices. The ideal tools will offer precision, reliability, and efficiency to meet the requirements for etching and deposition on both 100 mm and 200 mm diameter wafers. Tenderers with cutting-edge solutions that can achieve these high standards are encouraged to submit their proposals for this vital component in our technological advancement.

Förfarandets identifierare: a024c275-b92f-48d9-83b8-52aa370660c8

Typ av förfarande: Öppet

Förfarandet är påskyndat: nej

2.1.1. Föremålet för upphandlingen

Kontraktets art: Varor

Huvudklassificering (cpv): 38000000 Laboratorieutrustning, optisk utrustning och precisionsutrustning (exkl. glas)

2.1.2. Leveransplats

Del av land (NUTS): South-East (IE052)
Land: Irland

2.1.3. Värde

Beräknat värde exklusive moms: 3 300 000,00 EUR

2.1.4. Allmänna upplysningar

Rättslig grund:

Direktiv 2014/24/EU

2.1.5. Upphandlingsvillkor

Villkor för inlämning:

Högst antal delar som en anbudsgivare kan lämna anbud för: 4

2.1.6. Uteslutningsgrunder

Källor till uteslutningsgrunder: Upphandlingsdokument

5. Del (anbudsområde)

5.1. Del (anbudsområde): LOT-0001

Titel: Plasma Etcher ,Silicon ,Dielectrics

Beskrivning: Tenders are sought for the supply delivery, installation and commissioning of a suite of tools in 4 Lots for silicon-based and dielectric materials for University College Cork. The new plasma tools will enhance the capabilities at the Tyndall National Institute for the fabrication of semiconductor devices, especially silicon microelectronics and silicon MEMS, but also other materials such as germanium and silicon carbide. We invite proposals for the following lots; Lot 1 Plasma Etcher Silicon Dielectrics, advanced plasma etching system capable of etching for polysilicon poly-Si silicon dioxide SiO₂ silicon nitride SiN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 2 Plasma Etcher Metals Piezoelectrics, advanced plasma etching system capable of etching for aluminium Al and alloys molybdenum Mo aluminium scandium nitride AlScN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 3 Plasma Etcher Slow and Controllable Rate Atomic Layer Etch for Silicon Dielectrics, advanced plasma etching system capable of both conventional high-rate etching and slow and controllable rate atomic layer etching for silicon Si silicon dioxide SiO₂ silicon nitride SiN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 4 Plasma Deposition PECVD, advanced plasma enhanced chemical vapour deposition system capable of depositing dielectric SiO₂, SiN and amorphous a-Si thin films on semiconductor substrates. This equipment will be essential for etching and depositing a range of materials used in the fabrication of silicon microelectronics, silicon photonics and silicon MEMS devices. The ideal tools will offer precision, reliability, and efficiency to meet the requirements for etching and deposition on both 100 mm and 200 mm diameter wafers. Tenderers with cutting-edge solutions that can achieve these high standards are encouraged to submit their proposals for this vital component in our technological advancement.

Intern identifierare: 1

5.1.1. Föremålet för upphandlingen

Kontraktets art: Varor

Huvudklassificering (cpv): 38000000 Laboratorieutrustning, optisk utrustning och precisionsutrustning (exkl. glas)

5.1.2. Leveransplats

Del av land (NUTS): South-East (IE052)
Land: Irland

5.1.3. Uppskattad löptid

Varaktighet: 48 Månader

5.1.5. Värde

Beräknat värde exklusive moms: 3 300 000,00 EUR

5.1.6. Allmänna upplysningar

Reserverad upphandling:

Deltagande är inte reserverat.

Upphandlingsprojekt som inte finansieras med EU-medel

Upphandlingen omfattas av Världshandelsorganisationens avtal om offentlig upphandling, GPA
: ja

5.1.7. Strategisk upphandling

Syftet med strategisk upphandling: Det tas inte hänsyn till miljö, sociala aspekter eller innovation i upphandlingen

5.1.9. Urvalskriterier

Källor till urvalskriterier: Upphandlingsdokument

5.1.11. Upphandlingsdokument

Språk som upphandlingsdokumenten är officiellt tillgängliga på: engelska

Språk som upphandlingsdokumenten (eller delar av dem) är inofficiellt tillgängliga på: engelska

Sista dag för att begära kompletterande information: 07/07/2026 12:00:00 (UTC+01:00)

Centraleuropeisk tid / västeuropeisk sommartid

Adress till upphandlingsdokumenten: <https://www.etenders.gov.ie/epps/cft/listContractDocuments.do?resourceId=8424094>

5.1.12. Upphandlingsvillkor

Villkor för inlämning:

Elektronisk inlämning: Krävs

Adress för inlämning: <https://www.etenders.gov.ie/epps/cft/viewTenders.do?resourceId=8424094>

De språk som kan användas i anbudet eller anbudsansökningarna: engelska

Elektronisk katalog: Ej tillåten

Anbudsgivare får lämna in fler än ett anbud: Tillåten

Tidsfrist för mottagande av anbud: 24/07/2026 12:00:00 (UTC+01:00) Centraleuropeisk tid / västeuropeisk sommartid

Varaktighet under vilken anbudet måste förbli giltigt: 180 Dagar

Information om offentlig anbudsöppning:

Öppningsdatum: 24/07/2026 12:30:00 (UTC+01:00) Centraleuropeisk tid / västeuropeisk sommartid

Plats: <https://www.etenders.gov.ie/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=8424094>

Kontraktsvillkor:

Kontraktet måste genomföras inom ramen för program för skyddad anställning: Ännu ej känt

Elektronisk fakturering: Krävs

Elektronisk beställning kommer att användas: nej

Elektronisk betalning kommer att användas: nej

5.1.15. Metoder

Ramavtal:

Upphandlingen avser inte ett ramavtal

Information om det dynamiska inköpssystemet:

Upphandlingen avser inte ett dynamiskt inköpssystem

5.1.16. Kompletterande information, medling och prövning

Prövningsorganisation: The High Court of Ireland

Organisation som ger offlineåtkomst till upphandlingsdokumenten: Education Procurement Service (EPS)

Organisation som ger mer information om prövningsförfaranden: The High Court of Ireland

Organisation som mottar anbudsansökningar: Education Procurement Service (EPS)

Organisation som behandlar anbud: Education Procurement Service (EPS)

5.1. Del (anbudsområde): LOT-0002

Titel: Plasma Etcher ,Metals ,Piezoelectrics

Beskrivning: Tenders are sought for the supply delivery, installation and commissioning of a suite of tools in 4 Lots for silicon-based and dielectric materials for University College Cork. The new plasma tools will enhance the capabilities at the Tyndall National Institute for the fabrication of semiconductor devices, especially silicon microelectronics and silicon MEMS, but also other materials such as germanium and silicon carbide. We invite proposals for the following lots; Lot 1 Plasma Etcher Silicon Dielectrics, advanced plasma etching system capable of etching for polysilicon poly-Si silicon dioxide SiO₂ silicon nitride SiN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 2 Plasma Etcher Metals Piezoelectrics, advanced plasma etching system capable of etching for aluminium Al and alloys molybdenum Mo aluminium scandium nitride AlScN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 3 Plasma Etcher Slow and Controllable Rate Atomic Layer Etch for Silicon Dielectrics, advanced plasma etching system capable of both conventional high-rate etching and slow and controllable rate atomic layer etching for silicon Si silicon dioxide SiO₂ silicon nitride SiN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 4 Plasma Deposition PECVD, advanced plasma enhanced chemical vapour deposition system capable of depositing dielectric SiO₂, SiN and amorphous a-Si thin films on semiconductor substrates. This equipment will be essential for etching and depositing a range of materials used in the fabrication of silicon microelectronics, silicon photonics and silicon MEMS devices. The ideal tools will offer precision, reliability, and efficiency to meet the requirements for etching and deposition on both 100 mm and 200 mm diameter wafers. Tenderers with cutting-edge solutions that can achieve these high standards are encouraged to submit their proposals for this vital component in our technological advancement.

Intern identifierare: 2

5.1.1. Föremålet för upphandlingen

Kontraktets art: Varor

Huvudklassificering (cpv): 38000000 Laboratorieutrustning, optisk utrustning och precisionsutrustning (exkl. glas)

5.1.2. Leveransplats

Del av land (NUTS): South-East (IE052)

Land: Irland

5.1.3. Uppskattad löptid

Varaktighet: 48 Månader

5.1.5. Värde

Beräknat värde exklusive moms: 3 300 000,00 EUR

5.1.6. Allmänna upplysningar

Reserverad upphandling:

Deltagande är inte reserverat.

Upphandlingsprojekt som inte finansieras med EU-medel

Upphandlingen omfattas av Världshandelsorganisationens avtal om offentlig upphandling, GPA : ja

5.1.7. Strategisk upphandling

Syftet med strategisk upphandling: Det tas inte hänsyn till miljö, sociala aspekter eller innovation i upphandlingen

5.1.9. Urvalskriterier

Källor till urvalskriterier: Upphandlingsdokument

5.1.11. Upphandlingsdokument

Språk som upphandlingsdokumenten är officiellt tillgängliga på: engelska

Språk som upphandlingsdokumenten (eller delar av dem) är inofficiellt tillgängliga på: engelska

Sista dag för att begära kompletterande information: 07/07/2026 12:00:00 (UTC+01:00)

Centraleuropeisk tid / västeuropeisk sommartid

Adress till upphandlingsdokumenten: <https://www.etenders.gov.ie/epps/cft/listContractDocuments.do?resourceId=8424094>

5.1.12. Upphandlingsvillkor

Villkor för inlämning:

Elektronisk inlämning: Krävs

Adress för inlämning: <https://www.etenders.gov.ie/epps/cft/viewTenders.do?resourceId=8424094>

De språk som kan användas i anbudet eller anbudsansökningarna: engelska

Elektronisk katalog: Ej tillåten

Anbudsgivare får lämna in fler än ett anbud: Tillåten

Tidsfrist för mottagande av anbud: 24/07/2026 12:00:00 (UTC+01:00) Centraleuropeisk tid / västeuropeisk sommartid

Varaktighet under vilken anbudet måste förbli giltigt: 180 Dagar

Information om offentlig anbudsöppning:

Öppningsdatum: 24/07/2026 12:30:00 (UTC+01:00) Centraleuropeisk tid / västeuropeisk sommartid

Plats: <https://www.etenders.gov.ie/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=8424094>

Kontraktsvillkor:

Kontraktet måste genomföras inom ramen för program för skyddad anställning: Ännu ej känt

Elektronisk fakturering: Krävs

Elektronisk beställning kommer att användas: nej

Elektronisk betalning kommer att användas: nej

5.1.15. Metoder

Ramavtal:

Upphandlingen avser inte ett ramavtal

Information om det dynamiska inköpssystemet:

Upphandlingen avser inte ett dynamiskt inköpssystem

5.1.16. Kompletterande information, medling och prövning

Prövningsorganisation: The High Court of Ireland

Organisation som ger offlineåtkomst till upphandlingsdokumenten: Education Procurement Service (EPS)

Organisation som ger mer information om prövningsförfaranden: The High Court of Ireland

Organisation som mottar anbudsansökningar: Education Procurement Service (EPS)

Organisation som behandlar anbud: Education Procurement Service (EPS)

5.1. Del (anbudsområde): LOT-0003

Titel: Plasma Etcher ,Slow and Controllable Rate ,Atomic Layer Etch for Silicon , Dielectrics

Beskrivning: Tenders are sought for the supply delivery, installation and commissioning of a suite of tools in 4 Lots for silicon-based and dielectric materials for University College Cork. The new plasma tools will enhance the capabilities at the Tyndall National Institute for the fabrication of semiconductor devices, especially silicon microelectronics and silicon MEMS, but also other materials such as germanium and silicon carbide. We invite proposals for the following lots; Lot 1 Plasma Etcher Silicon Dielectrics, advanced plasma etching system capable of etching for polysilicon poly-Si silicon dioxide SiO₂ silicon nitride SiN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 2 Plasma Etcher Metals Piezoelectrics, advanced plasma etching system capable of etching for aluminium Al and alloys molybdenum Mo aluminium scandium nitride AlScN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 3 Plasma Etcher Slow and Controllable Rate Atomic Layer Etch for Silicon Dielectrics, advanced plasma etching system capable of both conventional high-rate etching and slow and controllable rate atomic layer etching for silicon Si silicon dioxide SiO₂ silicon nitride SiN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 4 Plasma Deposition PECVD, advanced plasma enhanced chemical vapour deposition system capable of depositing dielectric SiO₂, SiN and amorphous a-Si thin films on semiconductor substrates. This equipment will be essential for etching and depositing a range of materials used in the fabrication of silicon microelectronics, silicon photonics and silicon MEMS devices. The ideal tools will offer precision, reliability, and efficiency to meet the requirements for etching and deposition on both 100 mm and 200 mm diameter wafers. Tenderers with cutting-edge solutions that can achieve these high standards are encouraged to submit their proposals for this vital component in our technological advancement.

Intern identifierare: 3

5.1.1. Föremålet för upphandlingen

Kontraktets art: Varor

Huvudklassificering (cpv): 38000000 Laboratorieutrustning, optisk utrustning och precisionsutrustning (exkl. glas)

5.1.2. Leveransplats

Del av land (NUTS): South-East (IE052)

Land: Irland

5.1.3. Uppskattad löptid

Varaktighet: 48 Månader

5.1.5. Värde

Beräknat värde exklusive moms: 3 300 000,00 EUR

5.1.6. Allmänna upplysningar

Reserverad upphandling:

Deltagande är inte reserverat.

Upphandlingsprojekt som inte finansieras med EU-medel

Upphandlingen omfattas av Världshandelsorganisationens avtal om offentlig upphandling, GPA
: ja

5.1.7. Strategisk upphandling

Syftet med strategisk upphandling: Det tas inte hänsyn till miljö, sociala aspekter eller innovation i upphandlingen

5.1.9. Urvalskriterier

Källor till urvalskriterier: Upphandlingsdokument

5.1.11. Upphandlingsdokument

Språk som upphandlingsdokumenten är officiellt tillgängliga på: engelska

Språk som upphandlingsdokumenten (eller delar av dem) är inofficiellt tillgängliga på: engelska

Sista dag för att begära kompletterande information: 07/07/2026 12:00:00 (UTC+01:00)

Centraleuropeisk tid / västeuropeisk sommartid

Adress till upphandlingsdokumenten: <https://www.etenders.gov.ie/epps/cft/listContractDocuments.do?resourceId=8424094>

5.1.12. Upphandlingsvillkor

Villkor för inlämning:

Elektronisk inlämning: Krävs

Adress för inlämning: <https://www.etenders.gov.ie/epps/cft/viewTenders.do?resourceId=8424094>

De språk som kan användas i anbudet eller anbudsansökningarna: engelska

Elektronisk katalog: Ej tillåten

Anbudsgivare får lämna in fler än ett anbud: Tillåten

Tidsfrist för mottagande av anbud: 24/07/2026 12:00:00 (UTC+01:00) Centraleuropeisk tid / västeuropeisk sommartid

Varaktighet under vilken anbudet måste förbli giltigt: 180 Dagar

Information om offentlig anbudsöppning:

Öppningsdatum: 24/07/2026 12:30:00 (UTC+01:00) Centraleuropeisk tid / västeuropeisk sommartid

Plats: <https://www.etenders.gov.ie/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=8424094>

Kontraktsvillkor:

Kontraktet måste genomföras inom ramen för program för skyddad anställning: Ännu ej känt

Elektronisk fakturering: Krävs

Elektronisk beställning kommer att användas: nej

Elektronisk betalning kommer att användas: nej

5.1.15. Metoder

Ramavtal:

Upphandlingen avser inte ett ramavtal

Information om det dynamiska inköpssystemet:

Upphandlingen avser inte ett dynamiskt inköpssystem

5.1.16. Kompletterande information, medling och prövning

Prövningsorganisation: The High Court of Ireland

Organisation som ger offlineåtkomst till upphandlingsdokumenten: Education Procurement Service (EPS)

Organisation som ger mer information om prövningsförfaranden: The High Court of Ireland

Organisation som mottar anbudsansökningar: Education Procurement Service (EPS)

Organisation som behandlar anbud: Education Procurement Service (EPS)

5.1. Del (anbudsområde): LOT-0004

Titel: Plasma Deposition ,PECVD

Beskrivning: Tenders are sought for the supply delivery, installation and commissioning of a suite of tools in 4 Lots for silicon-based and dielectric materials for University College Cork. The new plasma tools will enhance the capabilities at the Tyndall National Institute for the fabrication of semiconductor devices, especially silicon microelectronics and silicon MEMS, but also other materials such as germanium and silicon carbide. We invite proposals for the following lots; Lot 1 Plasma Etcher Silicon Dielectrics, advanced plasma etching system capable of etching for polysilicon poly-Si silicon dioxide SiO₂ silicon nitride SiN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 2 Plasma Etcher Metals Piezoelectrics, advanced plasma etching system capable of etching for aluminium Al and alloys molybdenum Mo aluminium scandium nitride AlScN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 3 Plasma Etcher Slow and Controllable Rate Atomic Layer Etch for Silicon Dielectrics, advanced plasma etching system capable of both conventional high-rate etching and slow and controllable rate atomic layer etching for silicon Si silicon dioxide SiO₂ silicon nitride SiN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 4 Plasma Deposition PECVD, advanced plasma enhanced chemical vapour deposition system capable of depositing dielectric SiO₂, SiN and amorphous a-Si thin films on semiconductor substrates. This equipment will be essential for etching and depositing a range of materials used in the fabrication of silicon microelectronics, silicon photonics and silicon MEMS devices. The ideal tools will offer precision, reliability, and efficiency to meet the requirements for etching and deposition on both 100 mm and 200 mm diameter wafers. Tenderers with cutting-edge solutions that can achieve these high standards are encouraged to submit their proposals for this vital component in our technological advancement.

Intern identifierare: 4

5.1.1. Föremålet för upphandlingen

Kontraktets art: Varor

Huvudklassificering (cpv): 38000000 Laboratorieutrustning, optisk utrustning och precisionsutrustning (exkl. glas)

5.1.2. Leveransplats

Del av land (NUTS): South-East (IE052)

Land: Irland

5.1.3. Uppskattad löptid

Varaktighet: 48 Månader

5.1.5. Värde

Beräknat värde exklusive moms: 3 300 000,00 EUR

5.1.6. Allmänna upplysningar

Reserverad upphandling:

Deltagande är inte reserverat.

Upphandlingsprojekt som inte finansieras med EU-medel

Upphandlingen omfattas av Världshandelsorganisationens avtal om offentlig upphandling, GPA
: ja

5.1.7. Strategisk upphandling

Syftet med strategisk upphandling: Det tas inte hänsyn till miljö, sociala aspekter eller innovation i upphandlingen

5.1.9. Urvalskriterier

Källor till urvalskriterier: Upphandlingsdokument

5.1.11. Upphandlingsdokument

Språk som upphandlingsdokumenten är officiellt tillgängliga på: engelska

Språk som upphandlingsdokumenten (eller delar av dem) är inofficiellt tillgängliga på: engelska

Sista dag för att begära kompletterande information: 07/07/2026 12:00:00 (UTC+01:00)

Centraleuropeisk tid / västeuropeisk sommartid

Adress till upphandlingsdokumenten: <https://www.etenders.gov.ie/epps/cft/listContractDocuments.do?resourceId=8424094>

5.1.12. Upphandlingsvillkor

Villkor för inlämning:

Elektronisk inlämning: Krävs

Adress för inlämning: <https://www.etenders.gov.ie/epps/cft/viewTenders.do?resourceId=8424094>

De språk som kan användas i anbudet eller anbudsansökningarna: engelska

Elektronisk katalog: Ej tillåten

Anbudsgivare får lämna in fler än ett anbud: Tillåten

Tidsfrist för mottagande av anbud: 24/07/2026 12:00:00 (UTC+01:00) Centraleuropeisk tid / västeuropeisk sommartid

Varaktighet under vilken anbudet måste förbli giltigt: 180 Dagar

Information om offentlig anbudsöppning:

Öppningsdatum: 24/07/2026 12:30:00 (UTC+01:00) Centraleuropeisk tid / västeuropeisk sommartid

Plats: <https://www.etenders.gov.ie/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=8424094>

Kontraktsvillkor:

Kontraktet måste genomföras inom ramen för program för skyddad anställning: Ännu ej känt

Elektronisk fakturering: Krävs

Elektronisk beställning kommer att användas: nej

Elektronisk betalning kommer att användas: nej

5.1.15. Metoder

Ramavtal:

Upphandlingen avser inte ett ramavtal

Information om det dynamiska inköpssystemet:

Upphandlingen avser inte ett dynamiskt inköpssystem

5.1.16. Kompletterande information, medling och prövning

Prövningsorganisation: The High Court of Ireland

Organisation som ger offlineåtkomst till upphandlingsdokumenten: Education Procurement Service (EPS)

Organisation som ger mer information om prövningsförfaranden: The High Court of Ireland

Organisation som mottar anbudsansökningar: Education Procurement Service (EPS)

Organisation som behandlar anbud: Education Procurement Service (EPS)

8. Organisationer

8.1. ORG-0001

Officiellt namn: Education Procurement Service (EPS)

Registreringsnummer: IE 6609370 G

Postadress: Castletroy Limerick

Ort: Limerick

Postnummer: V94 DK53

Del av land (NUTS): Mid-West (IE051)

Land: Irland

E-postadress: info@educationprocurementservice.ie

Tfn: 000

Webbadress: <https://www.educationprocurementservice.ie/>

Köparprofil: <https://www.educationprocurementservice.ie/>

Den här organisationens roller:

Upphandlare

Organisation som ger offlineåtkomst till upphandlingsdokumenten

Organisation som mottar anbudsansökningar

Organisation som behandlar anbud

8.1. ORG-0002

Officiellt namn: The High Court of Ireland

Registreringsnummer: The High Court of Ireland

Avdelning: The High Court of Ireland

Postadress: Four Courts, Inns Quay, Dublin 7

Ort: Dublin

Postnummer: D07 WDX8

Del av land (NUTS): Dublin (IE061)

Land: Irland

E-postadress: HighCourtCentralOffice@courts.ie

Tfn: +353 1 8886000

Den här organisationens roller:

Prövningsorganisation

Organisation som ger mer information om prövningsförfaranden

8.1. ORG-0003

Officiellt namn: European Dynamics S.A.

Registreringsnummer: 002024901000

Avdelning: European Dynamics S.A.

Ort: Athens

Postnummer: 15125

Del av land (NUTS): Βόρειος Τομέας Αθηνών (EL301)

Land: Grekland

E-postadress: eproc-esender@eurodyn.com

Tfn: +30 2108094500

Den här organisationens roller:

TED eSender

10. Ändring

Version av det föregående meddelandet som ska ändras

:

46fee6a2-f409-4cd6-80db-618a50fcc925-01

Huvudskälet till ändringen

:

Information uppdaterad

Information om meddelandet

Identifierare/version för meddelandet: 7a2067c1-5ebe-49f4-b53b-0f9595ac5fa3 - 02

Formulärtyp: Konkurrensutsättning

Meddelandetyp: Meddelande om upphandling eller koncession – standardsystem

Meddelandets undertyp: 16

Avsändningsdatum för meddelandet: 13/07/2026 16:03:29 (UTC+01:00) Centraleuropeisk tid / västeuropeisk sommartid

Språk som det här meddelandet finns officiellt tillgängligt på: engelska

Meddelandets publiceringsnummer: 488696-2026

EUT S-nummer: 134/2026

Publiceringsdatum: 15/07/2026